Сведения о календарной загрузке оборудования ЦКП ИФМ РАН на 2019 год

Оборудование	Январь			Февраль				Март					Апрель				Май				Июнь					Июль				Август				Сентябрь					Октябрь				ноябрь					декабрь			
	2-ая неделя	3-я неделя	4-ая неделя	5-ая неделя	6-ая неделя	7-ая неделя	8-ая неделя	9-ая неделя	10-ая неделя	11-ая неделя	12-ая неделя	13-ая неделя	14-ая неделя	15-ая неделя	16-ая неделя	17-ая неделя	18-ая неделя	19-ая неделя	20-ая неделя	21-ая неделя	22-ая неделя	23-ая неделя	24-ая неделя	25-ая неделя	26-ая неделя	27-ая неделя	28-ая неделя	29-ая неделя	30-ая неделя	31-ая неделя	32-ая неделя	33-ая неделя	34-ая неделя	35-ая неделя	36-ая неделя	37-ая неделя	38-ая неделя	39-ая неделя	40-ая неделя	41-ая неделя	42-ая неделя	43-я неделя	44-ая неделя	45-ая неделя	46-ая неделя	47-ая неделя	48-ая неделя	49-ая неделя	50-ая неделя	51-ая неделя	52-ая неделя
Дифрактометр рентгеновский XPert PRO MRD (Philips)																																																				
Дифрактометр рентгеновский PANalitical XPert PRO MRD (Philips)																																																				
Лазерно-плазменный источник рентгеновского излучения																																																				
Сканирующий зондовый микроскоп Solver PRO-HV (НТ-МДТ)																																																				
ИК-Фурье спектрометр BOMEM DA3.36																																																				
ИК-Фурье спектрометр Vertex 80V (Bruker)																																																				
Фурье-спектрометр Инфралюм ФТ-801																																																				
Сканирующий электронный микроскоп Supra 50VP (Carl Zeiss)																																																				
Измерительная система Talysurf CCI 2000 (Taylor)																																																				
Вторично-ионный масс-спектрометр TOF-SIMS 5-100 (IONTOF)																																																				
Установка реактивного ионного травления с источником индуктивно связанной плазмы																																																				
Сверхпроводящая магнитная система																																																				
Анализатор спектра Agilent																																																				
Двухлучевая система с высоким разрешением для исследования и подготовки образцов Neon-40 (Carl Zeiss)																																																				
Цифровой осциллограф																																																				
Дифрактометр ренгеновский D8 Discover																																																				
Лазерный генератор микро-изображений mPG101																																																				
Станция ожижения гелия Cryomech LHeP18 с системой сбора газообразного гелия																																																				
Генератор сигналов Agilent Technologies E8257D																																																				
Атомно-силовой микроскоп Ntegra Prima																																																				
Сканирующий мульти-микроскоп СММ-2000																																																				
Вакуумная установка резистивного и электронно-лучевого испарения с холловским ионным источником Amod 206																																																				
Автоэмиссионный просвечивающий электронный микроскоп LIBRA® 200MC																																																				
Профилометр model 130 (Протон-МИЭТ)																																																				
Сканирующий туннельный микроскоп LT UHV SPM - Multiprobe S/XA (Omicron Nanotechnolgy)																																																				
Анализатор спектра Rohde&Schwarz FPC 1000																																																				
Оптический рефлектометр KIWI-7221																																																				

- На это время можно подать заявку на выполнение работ на установке

-Установка частично загружена. Заявки принимаются, но конкретное всемя работы требует дополнительного согласования

-Установка загружена либо находится на ремонте/профилактике. Заявки не принимаются.